



元素マッピング

蛍光X線 のデモ測定と最新テクノロジーのご紹介

■ ポータブル蛍光X線 デモンストレーション

6/19 (木) 10:00-14:00 ※入退室自由

場所：理系複合棟321室

講師：ブルカージャパン Michele 氏、水平 学 氏

非破壊・非接触で、最大 100 x 100 mm の元素マッピングを可能にする、ポータブル蛍光X線スキャナー ELIOによるデモ測定を行います。



■ 微小部蛍光X線 テクニカルセミナー

6/19 (木) 14:00-15:00

場所：理系複合棟321室

講師：ブルカージャパン 水平 学 氏

炭素から検出でき、最大 190 x 160 mm の元素マッピングを実現。凹凸試料にも対応した最新テクノロジーをご紹介します。

申込方法

テクニカルセミナーへの参加を希望する方は、下記リンク又は右側のQRコードに示すFormsより申込をお願いします。

<https://forms.office.com/r/Mc89rhkC7B>

※デモンストレーションは事前申込を行いません。上記時間内に自由にお越しください。



お問い合わせ

研究基盤統括センター 研究機器・技術支援部門

E-mail rfc-ans【☆】acs.u-ryukyu.ac.jp 【☆】を@マークへ変換してください。